



EVG Releases Next Generation Automated Photoresist Processor for 200mm Wafers – December 8, 2022

EVG、200mmウェハ対応の次世代版自動フォトレジスト処理装置を発売

掲載日 2022/12/09 14:56

オーストリアEV Group(EVG)は、同社の自動レジスト処理装置「EVG 150」として、新たに最先端パッケージング、MEMS、高周波(RF)、3Dセンシング、パワーエレクトロニクス、フォトニクスなどの次世代ニーズに対応する200mmウェハ対応の新モデルを発表した。

新モデルのEVG150プラットフォームは、前世代プラットフォーム比で、最大80%のスループット向上、同約50%に縮小したフットプリントなどのほか、先端機能の追加と更なる機能の拡張を実現している。



● 自動レジスト処理装置「EVG150」(出所:EVG Webサイト)

この次世代EVG150システムの最初の顧客は、EBS(Electronic Based Systems)の主要研究機関である「Silicon Austria Labs」で、同研究センターのマイクロシステム研究部門の責任者であるMohssen Moridi (

モーセン・モリディ氏は、「大手メーカーとの共同研究を通じて、**Industrie 4.0**、**IoT**、自動運転、サイバーフィジカルシステム(**CPS**)、人工知能(**AI**)、スマートシティ、スマートエネルギー、スマートヘルスの基盤を構築する重要な技術を開発している。**EVG**の次世代**EVG150**は、高い柔軟性を有しており、**EBS**のイノベーションを促進するために研究を進める顧客とともに、新たなプロセスと製品の大量生産の道を切り開くことに役立つ」と述べている。

<https://news.mynavi.jp/techplus/article/20221209-2533710/>